

MPI TS150-HP | 150 mmハイパワー・マニュアル・プローバー 最大10 kV/600 A 150 mm ハイパワー・マニュアル・プローバー

顕微鏡マウントおよび移動機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- リニアZリフト(構成変更が容易に)
- 25××25 mm エア・ベアリング機構 もしくは
50××50 mm XYリニア機構(オプション)

高さ調整機構付プラテン機構

- マイクロメーターにて微調整
- 20 mmの調整範囲

プローブ・プラテン

- 高剛性・安定設計
- DC/CV、RF測定用設計
- RFポジション用角型調整器
- すぐれた熱安定性 設計

独自のプラテンリフト

- コンタクト、コンタクト・セパレーション(300 μm)、ロード(3 mm)の3つの独立したポジショニング
- セーフティ・ロック機能
- ±1μmの再現性をもつ高コンタクト精度「オート・コンタクト」

プラテン・アーキング・シールド

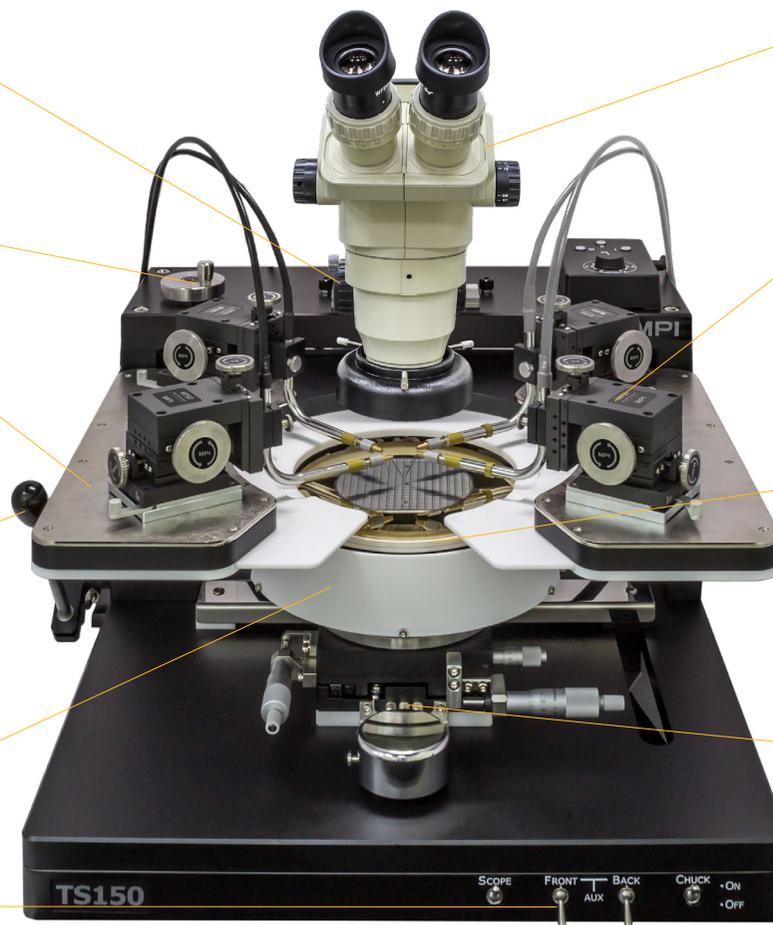
- 安全設計
- チャックからのアーク放電防止

真空制御を前面に設置

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記

オプション

- 防振プラットフォーム
- 真空ポンプ / エア・コンプレッサ



顕微鏡および顕微鏡オプション

- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI実体顕微鏡 ST45/MPI単眼鏡ST45/MPI単眼鏡SZ10/MZ12(12倍ズーム、作動距離95 mm)
- 高倍率顕微鏡 FS70/PSM-1000
- パソコンいらずのHDMI接続端子付きCCDカメラ

ポジションおよびハイパワープローブ

- 最大 大電流ポジション4台、高電圧ポジション8台搭載可能
- さまざまなポジションより選定可能
- 同軸/トライアキシャル 大電流/高電圧専用プローブ・アーム(最大600 パルス)

モジュラー式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- 300℃までの各種温度範囲より選定可能
- 薄いウェハーのハンドリングが可能
- 10 kV (同軸), 3 kV (トライアキシャル)
- 金メッキ加工により低コンタクト抵抗を実現
- 計測器との安全接続のためのMPIチャック・コネクタ

チャックXYステージ移動機構

- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 180 x 230 mm XYステージ稼働範囲
- 分解能 < 1.0 μm (0.04 mils) @ 500 μm/解像度
- ロードが簡単な広いY軸設計
- ±5° θ微調整機構

備考

- セーフティ・インターロック、遮光、EMIシールド付低雑音暗箱付属